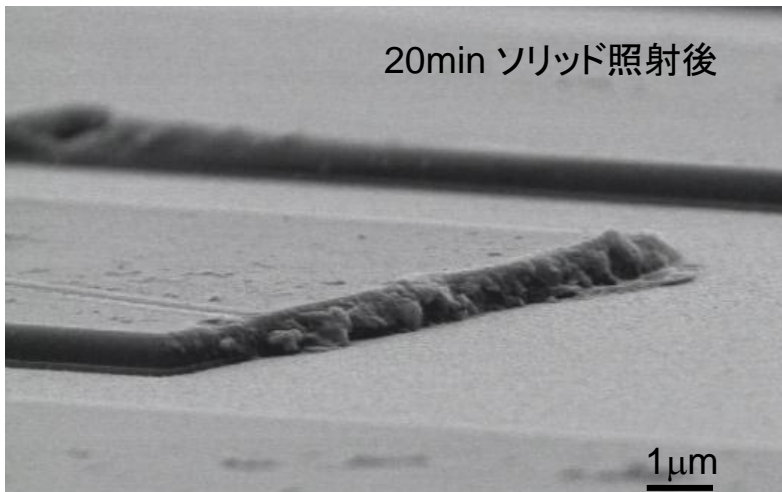
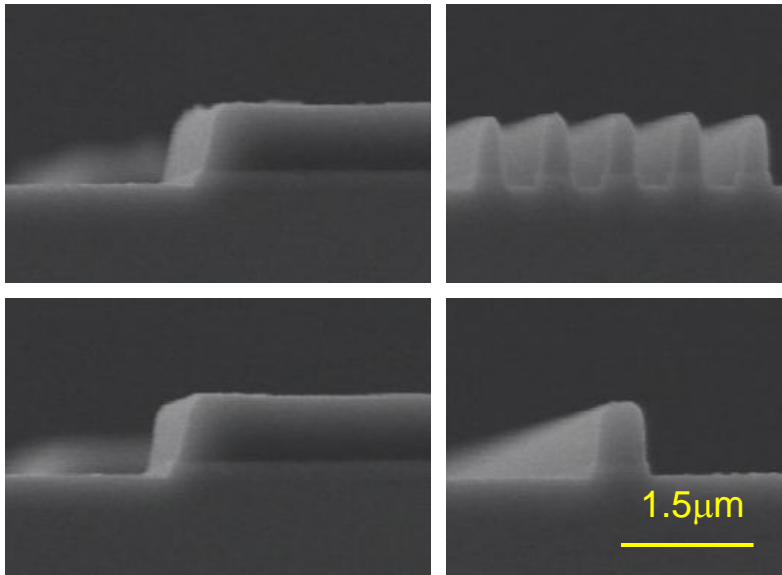
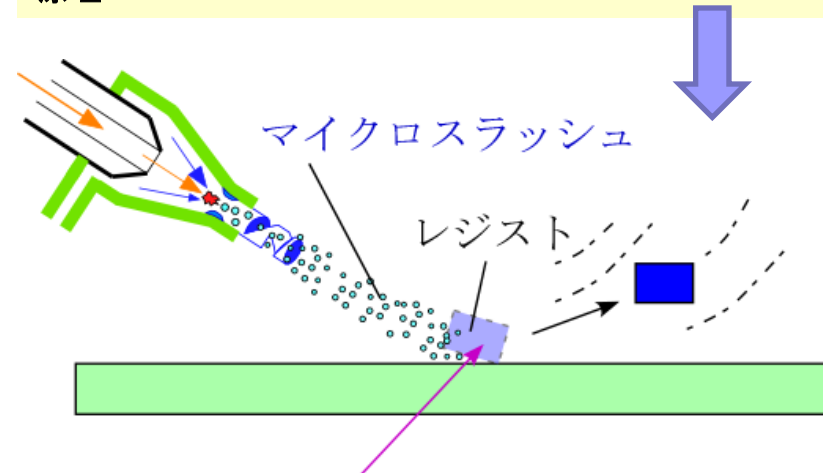


極低温マイクロ・ナノリッドジェット利用型アッシングレス半導体スーパー洗浄システムの開発



マイクロソリッドジェット照射実験(加熱無し)

* マイクロ・ナノリッドジェット流レジスト除去システムの原理



各種レジスト除去機構に起因するはく離機構

マイクロ・ナノリッドジェット流の有する各種レジスト除去機構

1. マイクロ・ナノリッド粒子の慣性力による**運動力学的**レジストはく離
2. マイクロ・ナノリッド粒子の液相変化による**液ジェット流によるレジストミキシング**によるはく離
3. マイクロ・ナノリッド粒子の固-液相変化から気相への蒸気相変化に基づく**体膨張・拡散効果**によるレジストはく離
4. マイクロ・ナノリッド粒子の**接触熱伝達**によるレジストの**熱収縮**によるはく離
5. ウェハ近傍に存在するマイクロ・ナノリッド粒子が誘起する**微小熱対流**によるはく離レジストの**再付着防止**機構